



ArF スキャナー

NSR-S322F

Proven Solutions Through Evolution



液浸装置で実績のある **Streamalign Platform** を搭載 重ね合わせ精度と生産性をさらに向上させた ArF スキャナー

ArF スキャナー NSR-S322F

NSR-S322F は、液浸装置で実績のある **Streamalign Platform** を搭載するとともに、重ね合わせ精度と生産性のさらなる向上を実現。お客様の生産ラインにおいて、高精度化と安定量産のニーズに応えます。

Performance

解像度	≤ 65 nm
NA	0.92
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	≤ 5 nm (MMO ^{*1})
スループット	≥ 230 wafers/hour (96 shots), ≥ 250 wafers/hour (96 shots) ^{*2}

^{*1} Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S322F#1 to S322F#2)

^{*2} オプション適用時

Streamalign Platform の主な特長

● Bird's Eye Control

重ね合わせ精度の大幅な向上

- 高精度エンコーダーおよび従来の干渉計のハイブリッドシステムにより、最適なステージパフォーマンスを実現
- 高度なフォーカスコントロール制御に加え、精度と安定性も大幅に改善
- 重ね合わせ精度 2 nm 以下まで向上

● Stream Alignment

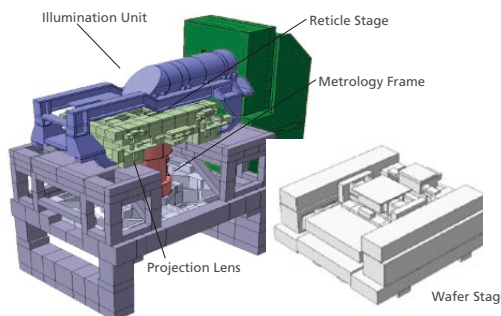
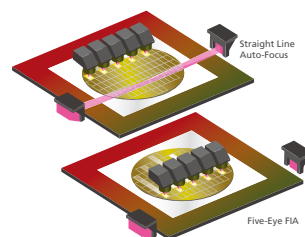
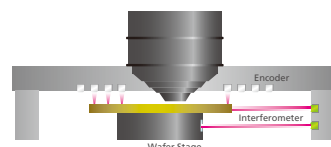
スループットと重ね合わせ精度の両立を実現

- 大幅に拡大されたビームスパンを持つ「ストレートラインオートフォーカス」により、ウェハ表面上を一気にマッピングし、フォーカス制御精度を改善
- FIA の 5 眼化により、生産性を確保しつつアライメント計測点数を増やすことが可能
- ウェハオーバーヘッド時間の大幅な改善
- スループット毎時 230 枚以上の性能を実現

● Modular² Structure

量産展開への迅速な対応を実現

- モジュール設計によるメンテナンスの簡易化
- モジュール設計に加え、より細かい部品の交換も可能なため、大幅にメンテナンス性が向上し、稼働率も向上
- 拡張性の高いプラットフォーム設計により、世代間に渡った装置利用を可能に



クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご 注 意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2024年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

<https://semi.nikon.com/>

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 140-8601 東京都品川区西大井 1-5-20 電話(03)6743-5533

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島 1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911